# MEMS 가속도센서를 이용한 경사도 측정장치

## A Slope Inclinometer based on MEMS Accelerometers

Ci-Moo Song

Sejong University

Abstract - This paper deals with a new two dimensional clinometer based on dual axis micromachined accelerometers. The clinometer is a small and low-cost product, which is mainly developed to help golfers read easily the tilt of a putting green. First, this paper proposes the principle of two dimensional clinometer and also a calibration method with respect to the offset voltage and sensitivity of a accelerometer. Experimental results on the developed clinometer show that the proposed clinometer can provide useful information on the tilt angle and direction of an inclined

Key Words: 경사계, clinometer, calibration, micromachine-d accelerometer, MEMS

#### 1. 서 론

미소전기기계시스템(MEMS: Micro Electro-Mechanical Systems)기술의 발달로 가속도센서의 용용분야가 더욱 확대되고 있으며, 가속도센서의 응용분야는 크게 자동차산업과 가전산업등에 적용 되어 움직임을 모니터링(monitoring)하고 상황을 검출하는 분야와 종래에 상대적으로 고가의 미소 기계부품을 사용하던 산업과 항공및 관성항법산업 등에 적용되는 계측제어분야로 나눌 수 있다. [1][2][3].

가속도센서는 센서에 작용하는 동적인 가속도와 정적인 가속도를 동시에 측정하는 센서로서 동적인 가속도가 영인 상태, 즉 정지한 상태에서 측정한 정적인 가속도는 중력가속도에 의한 가속도 성분이 며, 이를 적절히 이용하면 경사각을 구할 수 있다 [4]. 본 논문은 새로운 응용분야로서 퍼팅그린 (putting green)의 경사각과 경사방향을 간단하고 편리한 방법으로 측정할 수 있는 골퍼용 경사계인 디지털 수평계 개발과 관련된 것이다. 골프경기에 서 정확한 퍼팅을 하기 위해서는 퍼팅그린의 경사 를 정확하게 읽어야 할 필요성이 있으며, 개발된 소형 2차원 디지털수평계는 이 필요성을 십분 충족 할 수 있을 것으로 예상된다. 기존에 제안된 경사 각 측정방법은 1차원 경사계에 대한 것이며[4], 저 가의 MEMS가속도센서는 소자에 따라서, 동작조건 에 따라서 각각 센서의 응답특성이 변하므로 이를 보정하기 위한 적절한 보상방법을 사용하여야 한다 [5][6].

본 논문에서는 2차원평면의 경사각과 경사방향을 측정하기 위한 2축 관성센서를 이용한 경사계의 원

리를 제시하고, 퍼팅그린의 경사측정 사용환경에 적합한 소형의 휴대용 2차원 디지털경사계를 제작 하고 실험을 통하여 제안된 방법의 타당성을 보이 고자 한다.

# 2. 2축 관성센서를 이용한 2차원 경사계 2.1 MEMS 가속도센서

MEMS기술을 사용한 저가의 소형 가속도센서는 오프셋전압(offset voltage)과 감도(sensitivity)가 변동하는 특징이 있으며, 표 1에 나타낸 Kionix사 의 2축 가속도센서인 KXM52-1040은 온도에 따라 오프셋 전압과 감도가 변하며, 소자에 따라서도 변 하는 특성을 보인다. 따라서 오프셋전압과 감도에 대한 적절한 보상을 하여야 각각 정밀한 오프셋전 압  $V_{OFF}$ 와 감도  $K_a$ 를 식 (1)에 적용하여 정밀한 가속도 a의 측정이 가능함을 알 수 있다.

Acceleration range	±2.0[g]	-
Sensitivity	660[mV/g]	@3.3V
Sensitivity	±2.0[%] typical	-40℃~85℃
vs. Temp.	(±3.0[%] max.)	40 0 30 0
0g Offset vs.	±100[mV]	-40℃~85℃
Temp.		
Span	±1320[mV]	@3.3V

표 1. KXM52-1040 가속도 센서의 주요 사양

$$V_{out} = V_{off} + K_a \cdot a[V] \tag{1}$$

식 (1)에서 오프셋전압은 가속도가 영인 상태에 서의 센서출력전압이므로 센서에 작용하는 가속도 가 영인 수평정지상태에서 센서출력전압을 측정하 면  $V_{OFF}$ 을 구할 수 있다. 또한 식 (1)에서 중력가 속도인 1[g]가 정역 방향으로, 즉 ±1[g]가 센서에

작용하도록 센서를 배치하고 각각의 정지상태에서 측정한 출력전압을 이용하면 식 (2)와 같이 감도  $K_a$ 를 구할 수 있다.

$$K_a = \frac{V_{out}(+1g) - V_{out}(-1g)}{2}$$
 (2)

## 2.2 2차원 디지털 경사계

그림  $1e^2 xy$ 축 기준좌표와 경사각  $\theta$ 만큼 기울어진 정지한 평면상에 중력가속도 g에 의해 가장 크게 나타나는 가속도, 즉 지면에 가장 가까운 원주상의 점과 원의 중심점 z를 연결하는 선분위에 나타나는 최대 정적가속도  $g_{\theta}$ 를 나타내고 있다. 한편그림 1의 최대 정적 가속도  $g_{\theta}$ 는 항상 식 (3)과 같고, 경사각  $\theta$ 와의 관계는 식 (4)와 같다.

$$0 \le q_{\theta} \le q \tag{3}$$

$$q_{\theta} = q \cdot \cos(\pi/2 - \theta) = q \cdot \sin\theta$$
 (4)

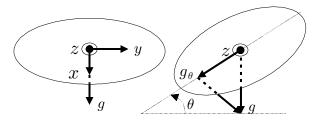


그림 1 평면상의 xy축 기준 좌표와 경사각

그러므로 가속도센서를 이용하여 중력가속도에 의한  $g_{\theta}$ 를 측정하면 식 (4)의 관계로부터 경사각  $\theta$ 를 식 (5)와 같이 구할 수 있으며, 식 (3)에 의하여 경사각의 범위는 식 (6)과 같다.

$$\theta = \sin^{-1}\left(g_{\theta}/g\right) \tag{5}$$

$$0^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ} \tag{6}$$

그림 2는 정지한 평면, 즉 중력가속도만 작용하는 평면에서의 가속도 관계를 나타낸 것으로 xy축에 각각 위치한 가속도센서에 의한 xy축 가속도  $g_x,g_y$ 를 나타내고 있다. 그림 2에서 최대 정적가속도  $g_\theta$ 와 기준좌표에 대한 경사방향을 나타내는 각  $\theta_z$ 를 이용하여 가속도  $g_x,g_y$ 를 구하면 식 (7)과 같다.

 $g_x\!=\!g_{ heta}\!\cdot\!\cos\!\theta_z$  ,  $g_y\!=\!g_{ heta}\!\cdot\!\sin\!\theta_z$  (7) 식 (7)에서 최대 정적가속도  $g_{ heta}$ 를 구하면 식 (8)과 같다.

$$g_{\theta} = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \tag{8}$$

한편, 식 (7)을 이용하여 경사방향을 나타내는 각

 $\theta_z$ 를 구하면 식 (9)와 같으며,  $\theta_z$ 의 범위는 식 (10)과 같다.

$$\theta_z = tan^{-1} \left( \frac{g_y}{q_x} \right) \tag{9}$$

$$-180^{\circ} \le \theta_z \le 180^{\circ} \tag{10}$$

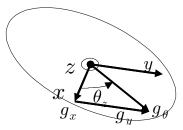


그림 2 정지한 평면상에서의 가속도와 경사방향

2차원 경사계는 2축 가속도센서를 그림 1의 평면상 기준좌표에 부착하고, 정지상태에서 2축의 가속도 성분을 각각 측정한 후에 식 (8)을 이용하여 최대 정적가속도  $g_{\theta}$ 를 먼저 계산하고, 식 (5)에 의하여 경사각  $\theta$ 를 구하며, 식 (9)를 이용하여 경사방향을 나타내는 각  $\theta_z$ 를 구한 값을 이용하여 만들수 있다.

#### 3. 실험 결과 및 고찰

본 논문에서 제안한 2차원 디지털경사계의 주요 구성요소는 10-bit A/D 변환기와 LCD Driver를 내장한 Microchip사의 PIC16F913 마이크로컨트롤러(Microcontroller)와 그림 4에 나타낸 전용 LCD, 그리고 표 1에 나타낸 2축 MEMS 가속도 센서이며, 제작한 경사계의 사진은 그림 4와 같다.

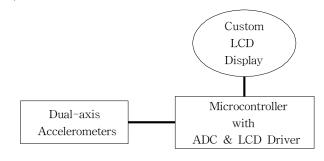


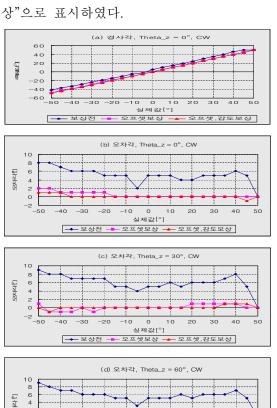
그림 3 2차원 디지털 경사계의 구성도

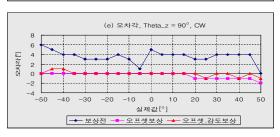




그림 4 2차원 디지털 경사계의 내부 및 외부 사진 실험은 완전히 조립된 제품(I'MARK)을 사용하

였으며, 측정의 정밀도를 높이기 위하여 256개의 측정값을 평균한 값을 사용하여 경사각과 경사방향을 나타내는 각도를 각각 측정하였다. 그림 5 (a)는경사 방향을 나타내는 각  $\theta_z = 0^\circ$  인 경우에 대한실제 경사각에 대한 측정 경사각을 나타낸 것이다. 그림 5 (b), 그림 5 (c), 그림 5 (d), 그림 5 (e)는각각  $\theta_z = 0^\circ$ ,  $\theta_z = 30^\circ$ ,  $\theta_z = 60^\circ$ ,  $\theta_z = 90^\circ$ 에 대한 측정 오차 각도를 나타낸 것이다. 그림 5에서센서의 공칭 데이터를 사용하여 측정한 경우를 "보상전"으로 표시하고, 실험으로 수평상태에서 측정한 오프셋전압을 사용하여 측정한 경우를 "오프셋보상"으로 표시하고, 실험으로 ±1g조건에서 식 (2)를 이용하여 측정한 감도와 앞에서 측정한 오프셋전압을 함께 사용하여 측정한 경우를 "오프셋전압을 함께 사용하여 측정한 경우를 "오프셋 전압을 함께 사용하여 측정한 경우를 "오프셋 단보상"으로 표시하였다.





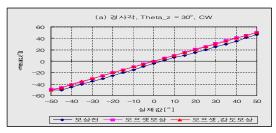
실제값[°]

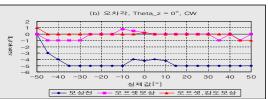
30

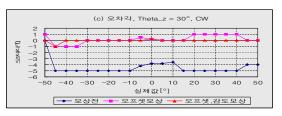
-40 -30 -20

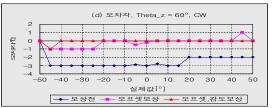
→ 보상전

그림 5 2차원 디지털 경사계의 측정 정밀도 (#1)









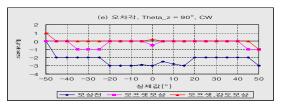
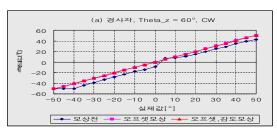
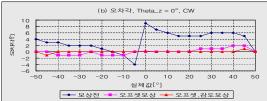
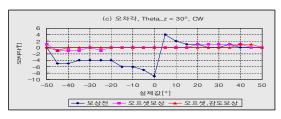
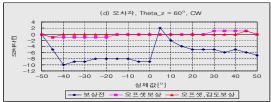


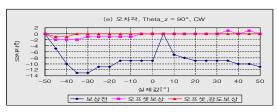
그림 6 2차원 디지털 경사계의 측정 정밀도 (#2)











## 그림 7 2차원 디지털 경사계의 측정 정밀도 (#3)

실험에서 경사각의 측정범위는 실제 경사각을 측정할 수 있는 장비의 측정범위를 고려하여 ±50°로 제한하였다. 그림 6과 그림 7은 각각 그림 5와 같은 실험 결과로서 다른 2개의 제품에 대하여 측정한 것이다. 표 1의 MEMS가속도센서의 주요 사양으로부터 알 수 있는 바와 같이 오프셋전압과 감도를 해당 센서에 대해서, 사용 조건에서 직접 측정하여 보정함으로써 그림 5, 그림 6, 그림 7에 나타낸 바와 같이 측정 정밀도를 상당한 정도로 개선할수 있음을 알 수 있다. 즉, 3개의 제품에 대한 위의실험 결과로부터 경사각을 정밀하게 측정하기 위해서는 오프셋전압과 감도를 보정하는 것이 필요함을알 수 있으며, 이를 통하여 ±1° 범위내의 경사각측정 정밀도를 얻을 수 있었다.

### 4. 결 론

본 논문에서는 2축 MEMS가속도센서를 사용한 2차원 경사계의 동작원리를 제시하고, 퍼팅그린의경사 측정 환경에 적절한 소형의 휴대용 2차원 디지털 경사계를 제작하고 실험을 통하여 제안한 방법의 타당성을 보였다. 또한 실험을 통한 오프셋전압과 감도를 구하여 센서에 따른 특성과 사용조건에 따른 특성을 반영한 실험결과를 제시하여 정밀한 경사각 측정을 위해서는 오프셋전압과 감도에 대한 보상이 필요함을 보였다.

## 참 고 문 헌

- [1] J. M. Stauffer, "Market Opportunities for Advanced MEMS Accelerometers and Overview of Actual Capabilities vs. Required Specifications", IEEE Position Location and Navigation Symposium, PLANS 2004, pp. 78–82, April 2004.
- [2] Navid Yazdi, Farrokh Ayazi, and Khalil Najafi, "Micromachined Inertial Sensors", Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 8, pp.1640–1659, August 1998.
- [3] B. E. Boser and R. T. Howe, "Surface Micromachined Accelerometers", IEEE Journal of Solid-state Circuits, vol. 31, no. 3, pp. 366–375, March 1996.
- [4] Application Note: Measuring Tilt with Low-g Accelerometers, Freescale Semi conductor, Inc., AN3107, pp. 1-7, 2005, 5.
- [5] 진용, 박찬국, 지규인, "온도에 따른 저급 IMU의 특성 분석 및 보상", 대한전기학회 하계학술대회 논문집, pp. 2365-2367, 2000, 7.
- [6] E. R. Bachmann, X, Yun, D. McKinney, R. B. McGhee, and M. J. Zyda, "Design and Implementation of MARG Sensors for 3-DOF Orientation Measurement of Rigid Bodies", Robotics & Automation Conf. pp. 1171-1178, 2003.